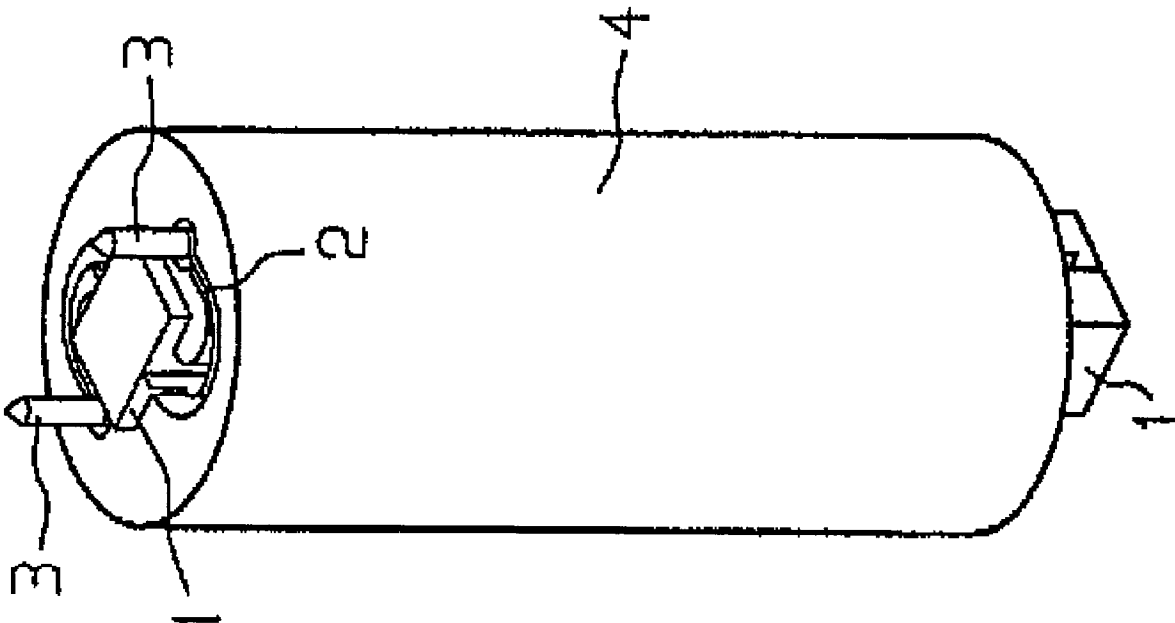


AN: PAT 1998-558218  
TI: Piezoelectric actuator e.g. for control of motor vehicle injection valve has electrical terminals and mounted in prefabricated hollow moulding provided with passivation layer from which electrical terminals are brought out  
PN: DE19715487-A1  
PD: 22.10.1998  
AB: The piezoelectric actuator (1) includes electrical terminals (3) for controlling the length of the actuator. The actuator is mounted in a prefabricated hollow moulding (4) which is at least partially moulded with a passivation layer. The electrical terminals (3) are brought out of the passivation layer and the hollow moulding. At least the top face of the actuator juts out over the hollow moulding, with the part of the actuator sticking out of the hollow moulding at least provided laterally with a passivation layer (8).; Provides cost-effective, and easy to fabricate actuator.  
PA: (SIEI ) SIEMENS AG;  
IN: FITZNER J; HAKAN Y; HEKELE W; KIRCHWEGER K; LEWENTZ G; RINK J; SCHUH C; YALCIN H;  
FA: DE19715487-A1 22.10.1998; DE19715487-C2 13.06.2002; WO9847188-A2 22.10.1998; EP976166-A2 02.02.2000;  
CO: AT; BE; CH; CY; CZ; DE; DK; EP; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; JP; LU; MC; NL; PT; SE; US; WO;  
DN: CZ; JP; US;  
DR: AT; BE; CH; CY; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LU; MC; NL; PT; SE;  
IC: H01L-041/053; H01L-041/083; H01L-041/09; H02N-002/02;  
MC: V06-M06D; V06-U03; X22-A02A;  
DC: V06; X22;  
FN: 1998558218.gif  
PR: DE1015487 14.04.1997;  
FP: 22.10.1998  
UP: 25.06.2002

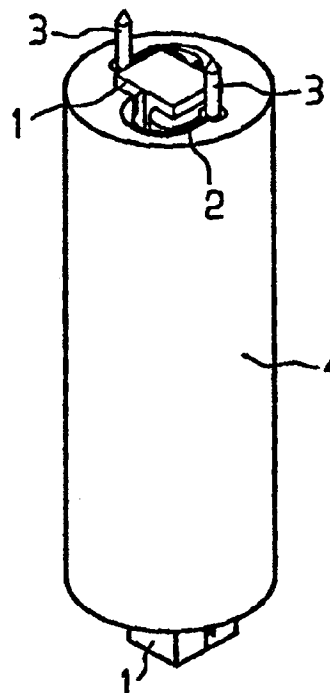






**PCT** WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro  
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation<sup>6</sup> : <b>H01L 41/083</b></p>	<p><b>A2</b></p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 98/47188</b> (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 22. Oktober 1998 (22.10.98)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/01021 (22) Internationales Anmeldedatum: 8. April 1998 (08.04.98) (30) Prioritätsdaten: 197 15 487.5 14. April 1997 (14.04.97) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FITZNER, Johannes [DE/DE]; Mittelweg 3D, D-93170 Bernhardswald (DE). RINK, Jürgen [DE/DE]; Lindenstrasse 16, D-92442 Wackersdorf (DE). KIRCHWEGGER, Karl [AT/DE]; Aussiger Strasse 6A, D-93057 Regensburg (DE). LEWENTZ, Günter [DE/DE]; Lärchenweg 5, D-93055 Regensburg (DE). YALCIN, Hakan [TR/DE]; An der Schergenbreite 26, D-93059 Regensburg (DE). SCHUH, Carsten [DE/DE]; Brunnenstrasse 73, D-85598 Baldham (DE). HEKELE, Wilhelm [DE/DE]; Gartenstrasse 2, D-83125 Eggstätt (DE).</p>		<p>(81) Bestimmungsstaaten: CZ, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i></p>
<p>(54) Title: PIEZOELECTRIC ACTUATOR WITH A HOLLOW PROFILE (54) Bezeichnung: PIEZOELEKTRISCHER AKTOR MIT EINEM HOHLPROFIL (57) Abstract <p>In a simple manufacturing process, the piezoelectric actuator is inserted into a pre-fabricated hollow profile which is then sealed with a passivating layer. The hollow profile is configured in such a way that the contact pins, which are connected to the piezoelectric actuator by means of contact lugs, are arranged in a precisely defined position.</p></p> <p>(57) Zusammenfassung <p>Für einen einfachen Fertigungsprozess wird der piezoelektrische Aktor in ein vorgefertigtes Hohlprofil eingebracht und das Hohlprofil mit einer Passivierungsschicht ausgegossen. Das Hohlprofil ist derart ausgebildet, daß Kontaktfste, die über Kontaktfahnen mit dem piezoelektrischen Aktor verbunden sind, in einer genau definierten Lage angeordnet sind.</p></p>		



# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

## Beschreibung

## Piezoelektrischer Aktor mit einem Hohlprofil

- 5 Die Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Aktor gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Piezoelektrische Aktoren werden beispielsweise in der Kraft-  
fahrzeugtechnik zur Ansteuerung von Einspritzventilen verwen-  
10 det.

Die Aufgabe der Erfindung beruht darin, einen kostengünstigen und einfach zu fertigenden piezoelektrischen Aktor bereit zu stellen.

15

Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung beruht darin, daß der Aktor kostengünstig hergestellt wird, indem der Aktor in ein vorgefertigtes Hohlprofil eingebettet  
20 wird. Dadurch entfällt ein Entformungsprozess, der bei einer Umspritzung des piezoelektrischen Aktors notwendig ist.

Weitere vorteilhafte Ausbildungen und Verbesserungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

25

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren näher erläutert; es zeigen:

- Figur 1 einen piezoelektrischen Aktor,  
30 Figur 2 ein Hohlprofil,  
Figur 3 ein Hohlprofil mit einem piezoelektrischen Aktor,  
Figur 4 einen passivierten piezoelektrischen Aktor,  
Figur 5 einen piezoelektrischen Aktor mit einem angespritzten Steckergehäuse und

Figur 6 einen piezoelektrischen Aktor mit einem aufgeschobenen Kontaktstecker.

Figur 1 zeigt einen piezoelektrischen Aktor 1, der aus zwei  
5 Stapeln alternierender Elektroden- und Keramikschichten 1 besteht. Die Elektrodenschichten sind mit zwei seitlich an jedem Stapel angebrachten, streifenförmigen Metallisierungen versehen, die jeweils mit einer elektrisch leitenden Kontaktfahne 2 verbunden sind. Jede Kontaktfahne 2 ist an einem Kontaktstift 3 angeschlossen, die parallel zur Längsrichtung der  
10 zwei Stapel 1 angeordnet sind und den oberen Stapel 1 in Längsrichtung überragen.

Figur 2 zeigt ein Hohlprofil 4, das eine zylindrische Außenform aufweist, die beispielsweise nach dem Stranggußverfahren, dem Spritzgußverfahren oder nach dem Extrudierverfahren als Kunststoffhülse hergestellt wurde.

Die Kontaktstifte 3 sind als starre Stifte ausgebildet und  
20 mittels Widerstands-, Laserschweißen oder Laserlöten mit der Kontaktfahne 2 verbunden. Das Hohlprofil 4 ist geringfügig kürzer als der Aktor 1 mit den zwei Stapeln.

Figur 2b zeigt schematisch die innere Kontur des Hohlprofils, die eine zentrale, im wesentlichen rechteckige Ausnehmung 5  
25 aufweist, von der an zwei gegenüberliegenden Seiten zwei Schlitz 6 ausgehen, die jeweils in eine Stiftausnehmung 7 münden. Die Schlitz 6 sind vorzugsweise in einem vorgegebenen Radius gekrümmt ausgebildet, wobei der obere Schlitz 6 in  
30 Richtung auf die linke Seitenfläche der zentralen Ausnehmung 5 und der untere Schlitz 6 in Richtung auf die rechte Seitenfläche der Ausnehmung 5 geführt ist. Die Schlitz 6 verzweigen sich ausgehend von der zentralen Ausnehmung 5 in Richtung auf die Stiftausnehmung 7. Die leicht gekrümmte Ausführung der  
35 Schlitz 6 ermöglicht ein einfaches Einführen der Kontaktfah-

3

nen 2 und der Kontaktstifte 3 in das Hohlprofil 4. Anstelle  
der in Figur 2 dargestellten Kontur des Hohlprofils sind auch  
andere Hohlprofile möglich, wobei im einfachsten Fall eine  
einzige zentrale Ausnehmung zur Aufnahme des Piezoaktors mit  
5 seinen elektrischen Anschlüssen 2, 3 ausreicht.

Die Schlitze 6 weisen im Übergangsbereich 22 zu den  
Stiftausnehmungen 7 einen kleineren Durchmesser auf als der  
Durchmesser der Kontaktstifte 3 ist. Auf diese Weise wird  
10 verhindert, daß die Kontaktstifte 3 aus der Stiftausnehmung 7  
herausrutschen. Dadurch werden die Kontaktstifte 3 in ihrer  
Position genau festgelegt und sind somit für einen automati-  
sierten Fertigungsprozess gut geeignet. Das in Figur 2 darge-  
stellte Hohlprofil hat weiterhin den Vorteil, daß es einfach  
15 und kostengünstig zu fertigen ist.

Figur 3 zeigt einen piezoelektrischen Aktor 1 mit Kontakt-  
stiften 3 und Kontaktfahnen 2, der in das Hohlprofil 4 einge-  
fügt ist. Der Aktor 1 befindet sich in der zentralen Ausneh-  
20 mung 5, von der aus die Kontaktfahnen 2 über die Schlitze 6  
zu den Stiftausnehmungen 7 geführt sind, in denen sich die  
Kontaktstifte 3 befinden. Vorzugsweise ragt der Aktor 1 über  
das obere und das untere Ende des Hohlprofils 4 heraus. Eben-  
so sind die Kontaktstifte 3 über das obere Ende des Hohlpro-  
25 fils 4 und über das obere Ende des Stapels 1 geführt. Die  
Kontaktstifte 3 sind in ihrer Position zueinander und zum  
Hohlprofil 4 genau festgelegt. Durch die leicht gekrümmte  
Ausführung der Schlitze 6 ist trotz der langen Kontaktfahnen  
2 eine relativ kompakte Bauweise des Aktors 1 möglich.

30

Figur 4 zeigt einen Piezoaktor mit einem Hohlprofil 4 ent-  
sprechend Figur 3, bei dem der verbleibende Raum zwischen dem  
Aktor 1 und den Ausnehmungen 5,6,7 des Hohlprofils 4 mit ei-  
ner Passivierungsschicht mindestens teilweise ausgefüllt ist,  
35 damit der Aktor 1 fest mit dem Hohlprofil 4 verbunden ist.

Die Passivierungsschicht im Innern des Hohlprofils 4 wird beispielsweise aus spritzfähigem Silikon hergestellt.

5 Zudem ist der über den oberen Rand des Hohlprofils 4 und über den unteren Rand des Hohlprofils 4 hinausragende Teil des Aktor 1 von einer elastischen Passivierung 8,15 mindestens seitlich umgossen, die beispielsweise aus streichfähigem Silikon, das nach der Verarbeitung aushärtet, hergestellt wird.

10 Die Oberseite der oberen Passivierungsschicht 8 und die Unterseite der unteren Passivierungsschicht 15 schließen mit dem oberen Ende und dem unteren Ende des oberen beziehungsweise des unteren Stapels 1 ab. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß der Aktor 1 an einem Gehäuse 13 oder an einem  
15 Stellglied direkt anliegt.

Vorzugsweise ist auch die Oberseite und die Unterseite des Aktors mit einer Passivierungsschicht vorgegebener Dicke abgedeckt, die als Dämpfungs- und Schutzpolster dient. Die Kontaktstifte 3 ragen über die obere Passivierungsschicht 8 hin-  
20 aus.

Der in Figur 4 dargestellte piezoelektrische Aktor ist leicht zu handhaben, einfach zu Kontaktieren und für die weitere  
25 Verarbeitung durch das umgebende, dichte Hohlprofil 4 und die Passivierungsschicht 8, 15 geschützt.

Eine bevorzugte weitere Bearbeitung des piezoelektrischen Aktors besteht darin, auf die Kontaktstifte 3 eine Kontaktplatte 10 aufzustecken, die in einem entsprechenden Abstand zwei  
30 durchgehende Kontaktlöcher 16 aufweist, in die die Kontaktstifte 3 eingesteckt werden, wie in Figur 6 dargestellt ist. Die Kontaktplatte 10 ist vorzugsweise aus einem isolierenden Kunststoff gebildet, wobei im Inneren der Kontaktplatte 10  
35 ausgehend von den Kontaktlöchern 16 jeweils eine elektrische



Leitung 17 zu einem Anschlußstift 18 geführt ist, die aus der Kontaktplatte 10 herausragen.

5 Für eine weitere Verarbeitung wird der piezoelektrische Aktor mit dem Hohlprofil 4 in ein Gehäuse 13 eingeschoben, wobei das Gehäuse 13 in einer Deckplatte 19 elektrisch isolierte Durchführungen 14 zum Durchführen der Kontaktstifte 3 aufweist, wie in Figur 5 dargestellt ist. Das Gehäuse 13 ist beispielsweise aus Metall, insbesondere Stahl oder Aluminium  
10 oder aus einer Keramik gefertigt. Die Durchführungen 14 sind bei einem elektrisch leitenden Gehäuse 13 isoliert ausgebildet.

Auf die Kontaktstifte 3 wird, wie in Figur 6 dargestellt, die  
15 Kontaktplatte 10 aufgesteckt. Anschließend werden der obere Teil des Gehäuses 13, die Kontaktstifte 3 und die Kontaktplatte 10 mit einem Steckergehäuse 20 umspritzt. Das Steckergehäuse 20 ist derart ausgebildet, daß die Anschlußstifte 18 in eine Anschlußkammer 12 ragen und somit für eine Kontaktierung bereit stehen.  
20

Figur 5 zeigt somit eine Baueinheit mit einem piezoelektrischen Aktor 1, mit Gehäuse 13 und mit einem Steckergehäuse 20, die fertig vormontiert ist und mit der Anschlußkammer 12  
25 auf einem entsprechenden Injektor aufgef lanscht werden kann.

## Patentansprüche

1. Piezoelektrischer Aktor (1) mit elektrischen Anschlüssen  
(3) zum Steuern der Länge des Aktors (1), **dadurch gekenn-**  
5 **zeichnet,**
  - daß der Aktor (1) in ein vorgefertigtes Hohlprofil (4) ein-  
gebracht ist, daß das Hohlprofil (4) mit einer Passivie-  
rungsschicht wenigstens teilweise ausgegossen ist, und daß  
10 die elektrischen Anschlüsse (3) aus der Passivierungs-  
schicht und dem Hohlprofil (4) herausgeführt sind.
2. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-  
zeichnet, daß mindestens die Oberseite des Aktors (1) über  
das Hohlprofil (4) hinausragt, und daß der aus dem Hohlprofil  
15 (4) herausragende Teil des Aktors (1) mindestens seitlich mit  
einer Passivierungsschicht (8) umgossen ist.
3. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-  
zeichnet, daß die elektrischen Anschlüsse in Form von Stiften  
20 (3) ausgebildet sind, die nahezu parallel zur Längsrichtung  
des Aktors (1) angeordnet sind, und daß die Stifte in Längs-  
richtung über den Aktor (1) auf einer Seite hinausragen.
4. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 3, dadurch gekenn-  
25 zeichnet, daß das Hohlprofil (4) eine zentrale Ausnehmung (5)  
für die Aufnahme des Aktors (1) und zwei seitlich zur zentra-  
len Ausnehmung (5) versetzte Stiftausnehmungen (7) aufweist,  
die über Schlitze (6) mit der zentralen Ausnehmung (5) ver-  
bunden sind.
- 30 5. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 4, dadurch gekenn-  
zeichnet, daß die Schlitze (6) im Übergang zu der Stiftaus-  
nehmung einen kleinere Breite aufweisen als die Stifte (3),  
damit die Stifte (3) in der Stiftausnehmung (7) festgehalten

werden und somit einen definierten Abstand zueinander aufweisen.

5 6. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Hohlprofil (4) mindestens teilweise in ein Gehäuse (13) eingebracht ist, daß die Stifte (3) durch das Gehäuse (13) in ein an das Gehäuse (13) angespritztes Steckergehäuse (11) geführt sind, daß die Stifte (3) mit einer Kontaktplatte (10) mit Steckerfahnen (18) angeschlossen sind,  
10 die in eine Anschlußkammer (12) ragen.

7. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Stifte (3) über Folien (2) an den Aktor (1) angeschlossen sind, und daß die Schlitze (6) senkrecht  
15 zur Längsrichtung des Aktors (1) gesehen in einer gekrümmten Bahn ausgebildet sind, in der die Folien (2) geführt sind.

1/3

FIG 1

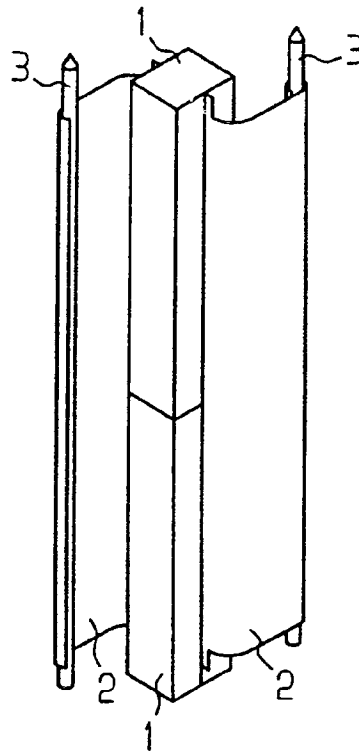


FIG 2A

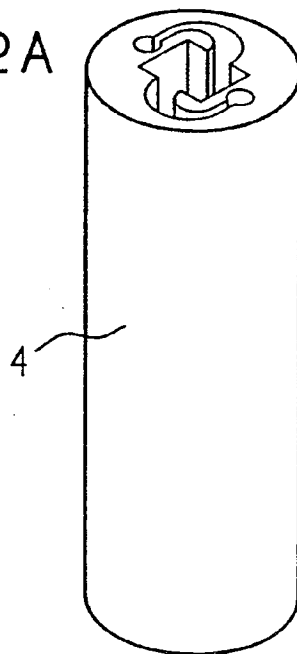
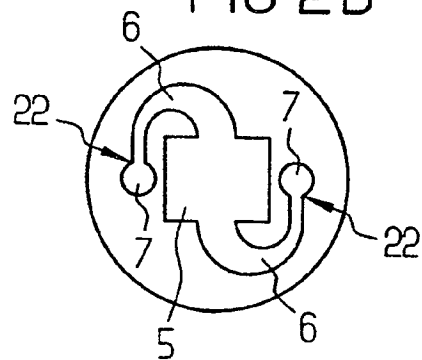


FIG 2B



2/3

FIG 3

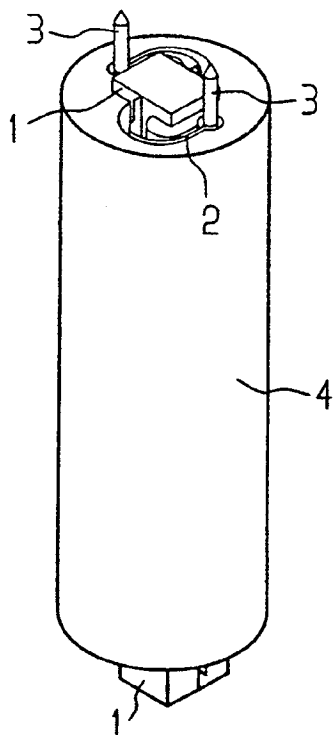
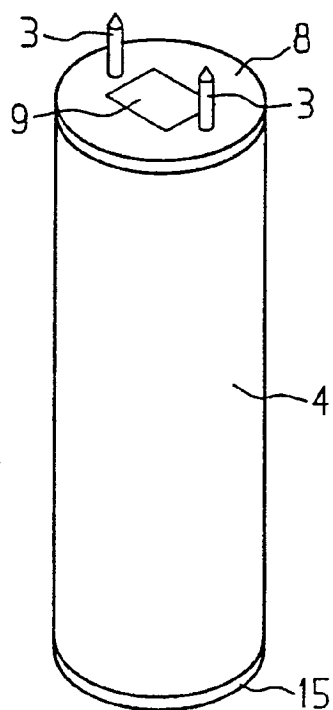


FIG 4



3/3

FIG 5

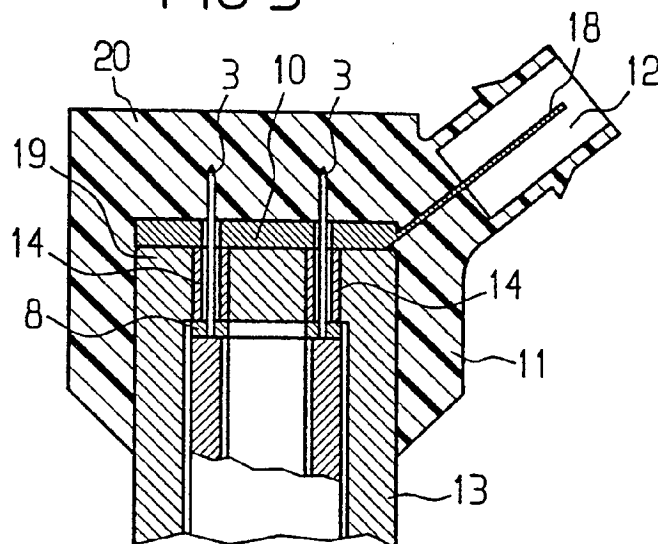
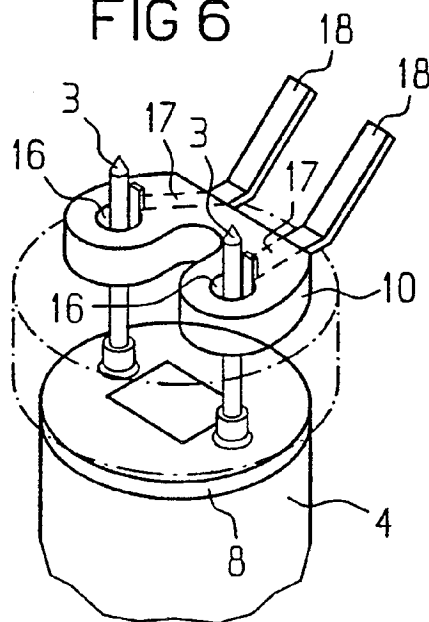
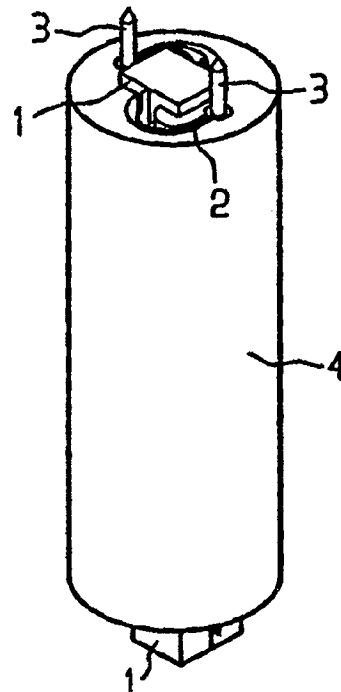


FIG 6





<b>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> :</b>  <b>H01L 41/083, 41/053</b>	<b>A3</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/47188</b>  <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 22. Oktober 1998 (22.10.98)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/DE98/01021 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 8. April 1998 (08.04.98)  <b>(30) Prioritätsdaten:</b> 197 15 487.5      14. April 1997 (14.04.97)      DE  <b>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):</b> SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).  <b>(72) Erfinder; und</b> <b>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US):</b> FITZNER, Johannes [DE/DE]; Mittelweg 3D, D-93170 Bernhardswald (DE). RINK, Jürgen [DE/DE]; Lindenstrasse 16, D-92442 Wackerersdorf (DE). KIRCHWEGGER, Karl [AT/DE]; Aussiger Strasse 6A, D-93057 Regensburg (DE). LEWENTZ, Günter [DE/DE]; Lärchenweg 5, D-93055 Regensburg (DE). YALCIN, Hakan [TR/DE]; An der Schergenbreite 26, D-93059 Regensburg (DE). SCHUH, Carsten [DE/DE]; Brunnenstrasse 73, D-85598 Baldham (DE). HEKELE, Wilhelm [DE/DE]; Gartenstrasse 2, D-83125 Eggstätt (DE).		<b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> CZ, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  <b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>  <b>(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:</b> 28. Januar 1999 (28.01.99)
<b>(54) Title: PIEZOELECTRIC ACTUATOR WITH A HOLLOW PROFILE</b> <b>(54) Bezeichnung: PIEZOELEKTRISCHER AKTOR MIT EINEM HOHLPROFIL</b> <b>(57) Abstract</b> <p>In a simple manufacturing process, the piezoelectric actuator is inserted into a pre-fabricated hollow profile which is then sealed with a passivating layer. The hollow profile is configured in such a way that the contact pins, which are connected to the piezoelectric actuator by means of contact lugs, are arranged in a precisely defined position.</p> <b>(57) Zusammenfassung</b> <p>Für einen einfachen Fertigungsprozess wird der piezoelektrische Aktor in ein vorgefertigtes Hohlprofil eingebracht und das Hohlprofil mit einer Passivierungsschicht ausgegossen. Das Hohlprofil ist derart ausgebildet, daß Kontaktfifte, die über Kontaktfahnen mit dem piezoelektrischen Aktor verbunden sind, in einer genau definierten Lage angeordnet sind.</p>		



### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat'l Application No

PCT/DE 98/01021

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 H01L41/083 H01L41/053

According to International Patent Classification(IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22 February 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27 October 1988 see abstract	1
A	EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7 June 1989 see abstract; figure 3	1
A	EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 27 February 1991 see abstract	1



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 October 1998

Date of mailing of the international search report

21/10/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Pelsers, L

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 98/01021

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0319038 A	07-06-1989	JP 2125675 A	14-05-1990
		JP 1146379 A	08-06-1989
		DE 3850641 D	18-08-1994
		DE 3850641 T	27-10-1994
EP 0414138 A	27-02-1991	DE 3927406 A	21-02-1991
		DE 59007614 D	08-12-1994
		ES 2063876 T	16-01-1995
		JP 3089571 A	15-04-1991
		PT 95020 A,B	30-04-1992

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationale Aktenzeichen

PCT/DE 98/01021

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 H01L41/083 H01L41/053

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung ---	1
A	EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 ---	1
A	EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 27. Februar 1991 siehe Zusammenfassung -----	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. Oktober 1998

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

21/10/1998

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Pelsers, L

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern: ales Aktenzeichen

PCT/DE-98/01021

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0319038 A	07-06-1989	JP 2125675 A	14-05-1990
		JP 1146379 A	08-06-1989
		DE 3850641 D	18-08-1994
		DE 3850641 T	27-10-1994
EP 0414138 A	27-02-1991	DE 3927406 A	21-02-1991
		DE 59007614 D	08-12-1994
		ES 2063876 T	16-01-1995
		JP 3089571 A	15-04-1991
		PT 95020 A,B	30-04-1992